

走査型透過電子顕微鏡・JEM2100F

製造元	日本電子
仕様	加速電圧 200 kV、EDX 付属 https://www.jeol.co.jp/products/detail/JEM-2100F.html
保有部署	化学工学専攻
設置場所	桂・A2棟・1階115室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-kako
注意事項等	測定前に使用者講習の受講が必要。ただし、講習会は不定期の開催で、ご予約いただいてもすぐに利用できるわけではありませんので、ご了承ください。また、有機物が多く含まれたサンプルの測定はお控えください。
連絡先	化学工学専攻界面制御工学研究室 准教授 渡邊 哲 075-383-2682 nabe@cheme.kyoto-u.ac.jp
キーワード	組成分析、マッピング、無機粒子、金属粒子
機器コード	0000105001
自由記入欄	本装置は、高輝度で高い干渉性・安定度の電子線が得られるフィールドエミッション電子銃を搭載し、ナノスケールオーダーの像観察や分析が可能です。観察モードにはTEMとSTEMの2種類があり、STEMモードでは、付属しているエネルギー分散型X線分析装置(EDX)を用いたEDXマッピングにより、観察領域の組成分析を行うことができます。

